

廢照明光源回收貯存清除處理方法及設施標準

部分條文修正總說明

為規範應回收廢照明光源清理作業，行政院環境保護署於九十一年九月十一日訂定發布「廢照明光源回收貯存清除處理方法及設施標準」（以下簡稱本標準），並於九十六年十月一日及一百零五年十月二十五日二次修正。

本次修正係為強化防制汞逸散情形，新增負壓管理規範。另因汞水俣公約之限汞措施，致含汞照明光源回收處理量隨營業量持續下降之趨勢，考量業者若僅申請處理發光二極體（Light Emitting Diode，以下簡稱 LED）廢照明光源，無須限制廠區面積，爰修正本標準部分條文，其修正要點如下：

- 一、配合應回收廢棄物回收處理業管理辦法之申報方式已改為每月申報，爰修正文字。（修正條文第三條）
- 二、依實務處理情形，明確處理設備及管理範圍，以避免執行管理作業時產生爭議。（修正條文第五條）
- 三、為強化防制汞逸散，依實務處理情形，新增負壓管理規範。另考量業者若僅申請處理 LED 廢照明光源，無須限制廠區面積，爰增列但書規定。（修正條文第六條）

廢照明光源回收貯存清除處理方法及設施標準

部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 廢照明光源回收、貯存、清除方法及設施，應符合下列規定： 一、應置於足以防止非意外破損之堅固貯存容器內。 二、應貯存於回收、處理場（廠）內，且貯存量不得超過該場（廠）前一季營運<u>月</u>報表申報之月平均量。 三、貯存之地點、容器、設施應經常保持清潔完整，且不得有廢棄物溢散、洩漏、飛散、散發惡臭、污染地面或積水等情事。 四、回收、貯存場地及貯存設施應具有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施，且貯存地面應為不透水鋪面。 五、應具有分區、分類之貯存設施及標示，其分區貯存高度不得超過六公尺，相鄰堆置之高度差不得超過一．五公尺。分區貯存寬度及長度均不得超過二十公尺，各區域間應有一公尺以上之分隔走道。 六、分區、分類貯存之廢照明光源應採取繩索捆綁、護網或其他必要措施，以防止發生掉落、傾	第三條 廢照明光源回收、貯存、清除方法及設施，應符合下列規定： 一、應置於足以防止非意外破損之堅固貯存容器內。 二、應貯存於回收、處理場（廠）內，且貯存量不得超過該場（廠）前一季營運季報表申報之月平均量。 三、貯存之地點、容器、設施應經常保持清潔完整，且不得有廢棄物溢散、洩漏、飛散、散發惡臭、污染地面或積水等情事。 四、回收、貯存場地及貯存設施應具有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施，且貯存地面應為不透水鋪面。 五、應具有分區、分類之貯存設施及標示，其分區貯存高度不得超過六公尺，相鄰堆置之高度差不得超過一．五公尺。分區貯存寬度及長度均不得超過二十公尺，各區域間應有一公尺以上之分隔走道。 六、分區、分類貯存之廢照明光源應採取繩索捆綁、護網或其他必要措施，以防止發生掉落、傾	因應應回收廢棄物回收處理業管理辦法之申報方式已改為每月申報，爰修正第二款文字。

倒或崩塌等情事。 七、其他經中央主管機關指定者。	倒或崩塌等情事。 七、其他經中央主管機關指定者。	
第五條 <u>下列廢照明光源之處理設備、貯存設施及處理後產生之廢棄物應設置、貯存於隔離區：</u> <u>一、汞蒸餾處理設備。</u> <u>二、汞與其化合物之貯存設施。</u> <u>三、未經汞回收處理作業前之螢光粉。</u> <u>四、未經汞回收處理作業前之活性碳。</u>	第五條 廢照明光源之處理設備及廢照明光源處理後產生之汞與其化合物之貯存設施，應設置於隔離區；未經汞回收處理作業前之螢光粉及活性碳，應貯存於隔離區。	依實務處理情形，明確處理設備及管理範圍，以避免執行管理作業時產生爭議，爰修正文字。
第六條 廢照明光源之處理方法及設施，應符合下列規定： 一、具有排水及廢水截流設施。 二、應設置於有屋頂且四周為混凝土結構之場(廠)內，其地面應為不透水鋪面，以防止廢棄物滲入地下或污染土壤、地下水體。 三、應具有汞回收設施及防止廢棄物及廢水溢散、散發惡臭、污染地面及影響四周環境品質之必要措施。<u>處理設備應設置防止粉塵逸散措施，並維持設備負壓，另應每日自主檢查設備負壓及粉塵狀況並記錄之。</u> 四、廠區面積(含暫存區)不得低於六百坪，其中廢照明光源處理專用廠房面積不得低於三百坪。<u>但僅申請處理發光二極體</u>	第六條 廢照明光源之處理方法及設施，應符合下列規定： 一、具有排水及廢水截流設施。 二、應設置於有屋頂且四周為混凝土結構之場(廠)內，其地面應為不透水鋪面，以防止廢棄物滲入地下或污染土壤、地下水體。 三、應具有汞回收設施及防止廢棄物及廢水溢散、散發惡臭、污染地面及影響四周環境品質之必要措施。 四、廠區面積(含暫存區)不得低於六百坪，其中廢照明光源處理專用廠房面積不得低於三百坪。 五、應備有緊急應變措施及污染防治計畫書。 六、其他經中央主管機關指定者。	一、依實務處理情形，修正第三款規定，新增負壓管理規範(如設備開口之圍封裝置及輸送管線包圍等)，以強化防制汞逸散。 二、因含汞照明處理廠須分別設置直管及非直管處理設備加上汞蒸餾設備等污染防制設施，且為避免運送處理過程中產生破損，故其廠區面積及專用處理面積始有最低限制。但因汞水俣公約之限汞措施，致含汞照明回收處理量持續下降，考量業者若僅申請處理 LED 廢照明光源，無須區分直管及非直管，且無破損疑慮，故無須限制廠區面積，爰修正第四款，增列但書規定。

<u>(Light Emitting Diode，以下簡稱LED)</u>廢照明光源項目者，不在此限。 五、應備有緊急應變措施及污染防治計畫書。 六、其他經中央主管機關指定者。		
第八條 應回收之廢照明光源不得與其他非屬公告應回收之廢照明光源合併處理。 LED 廢照明光源不得與含汞廢照明光源共用處理設備。	第八條 應回收之廢照明光源不得與其他非屬公告應回收之廢照明光源合併處理。 <u>發 光 二 極 體</u> <u>(Light Emitting Diode，以下簡稱LED)</u>廢照明光源不得與含汞廢照明光源共用處理設備。	配合第六條第四款修正文字。